

秋田県産業技術センター

施設・設備リスト

2019.10.01 技術イノベーション部

秋田県産業技術センター 施設・設備利用のご案内

秋田県産業技術センターでは、試験研究、技術支援・相談、技術者育成、研究会活動、研修会・講習会の開催、技術情報の提供などの業務を行っております。

当センターは、県内企業をはじめ外部の方に施設や設備機器を以下のとおり開放しております。

ご利用の留意事項

(1)利用者

特に制限はありません。

(2)利用対象施設、設備機器および使用料金

施設および設備使用料に記載しているとおりです。

(3)利用日時

原則として、当センターの休業日を除く午前9時から午後5時までです。

(4)利用・申し込み方法

あらかじめ電話等により、対象設備、利用日時等をご連絡のうえ、当日まで申請手続きが必要です。
使用が可能な場合は、許可証を交付します。

(5)使用方法

設備機器の使用方法については、必要に応じて当センター職員が指導します。

(6)支払い方法

当センターで発行する納入通知書により、指定金融機関に納付ください。

(7)ご利用にあたっての遵守事項

- ①会議室等の使用に際しての机、椅子の準備および復旧は、使用者の責任において行ってください。
- ②茶器は無償で貸付しますが、消耗品はお持参いただき、後片付けは使用者の責任において行ってください。
- ③館内は禁煙です。
- ④設備機器のご利用にあたっては、原則として危険物および有害物質の持ち込みを禁止します。
- ⑤当センターの施設および設備機器をき損した場合は、直ちに届出願います。
故意または過失によると認められる場合には、損害賠償の責任が生じますので、ご注意ください。

【申し込み・照会先】

秋田県産業技術センター 技術イノベーション部
〒010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄4番地の1 1
TEL 018-862-3414
FAX 018-865-3949
Eメール soudanshitu@rdc.pref.akita.jp
ホームページ <http://www.rdc.pref.akita.jp>

施設使用料および設備使用料

1. 開放研究室

(1)本館

区分	面積[m ²]	室数	使用料金(円/月)
開放研究室A	59	1	71,130
開放研究室B	46	6	67,890
開放研究室C	40	2	45,260

(2)高度技術研究館

区分	面積[m ²]	室数	使用料金(円/月)
高機能開放研究室	61.44	5	99,630

2. 講堂・研修室・会議室・展示室

(1)本館

区分	収容人数[人]	使用料(円)		
		9:00～12:00	13:00～17:00	9:00～17:00
講堂	100	3,600	4,800	8,400
研修室B	20	1,110	1,480	2,590
展示室		1,360(1日)		

以下の付属備品が利用できません(無料)ので、施設の使用申請の段階でお申し込みください。

液晶プロジェクタ、VHSビデオデッキ、スクリーン、ホワイトボード
オーバーヘッドプロジェクタ、黒板、ワイヤレスマイク

(2)高度技術研究館

区分	収容人数[人]	使用料(円)		
		9:00～12:00	13:00～17:00	9:00～17:00
視聴覚研修室	100	9,900	13,200	23,100
研修室A	24	3,600	4,800	8,400

附属設備

区分		使用単位	使用料(円)
視聴覚研修室	映像装置	一式1時間 につき	2,150
	同時通訳装置		1,620
研修室A	オーバーヘッドプロジェクタ	一式1時間 につき	530
	拡声装置		530

3. 機器設備

次頁以降の一覧表をご参照ください。

(注1) 使用時間が1時間未満である時、または当該時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算した使用料となります。

(注2) 附属装置の設備使用料が追加される場合があります。

秋田県産業技術センター機器設備一覧

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
1	PC制御画像認識塗布システム	武蔵エンジニアリング株式会社	SHOTMASTER SM300DSS-3A+IMAGE MASTER 350PCSmart	28	220	熊谷
2	レーザーカッター	エピログ社	Epilog Mini 24	29	270	熊谷
3	放射線(α線、β線、γ線)測定器	日立アロカメディカル(株)	TCS-362,TCS-172B,ICS-323C	23	110	遠田
4	シグナルジェネレータ	アジレントテクノロジー	E4426B	14	120	丹
5	低雑音振幅器	MITEQ	NSP2000-P	17	110	丹
6	ローパスフィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	NF 3660	4	440	丹
7	非接触三次元デジタイザー	Steinbichler	COMET	21	1,990	黒沢
8	電源ノイズ測定器	(株)TFF(テクトロニクス)	MDo4104-6	23	250	佐々木(大)
9	全光束測定システム	オーシャンフォトニクス	OP-FLUX-76-CA	23	2,410	梁瀬
10	精密騒音計	リオン(株)	NL-52	25	100	内田(勝)
11	超高精度三次元測定器	Panasonic	UA3P-300	20	2,930	久住
12	非接触式表面性状評価装置	Zygo	NewView6300	19	1,150	久住
13	非接触式フィゾー干渉計	Zygo	GPI XP/D	19	580	久住
14	4インチ光学原器	Zygo	TS f/0.65, f/1.5, f/3.3	21	300	久住
15	フィゾー干渉計用球面測定ジグ	ZYGO	フィゾー干渉計用球面測定ジグ	23	140	久住
16	総合型金属顕微鏡	オリンパス(株)	DSX500,DSX100	25	540	黒沢
17	CNC3次元測定機	カールツァイス(株)	PRISMO 5 HTG-S	7	470	加藤
18	真円度測定機	ランクテラーホブソン	タリロンド262型	8	110	加藤
19	CNC三次元測定機用データ処理装置	(株)東京精密	Calypsoシステム	18	850	加藤
20	超高倍率3次元複合顕微鏡	島津製作所	ナノサーチ顕微鏡SFT-3500ほか	17	1,680	加藤
21	表面粗さ測定機	(株)東京精密	サーコム3000A-3DF-DX-S	13	120	加藤
22	高精度CNC画像測定機	(株)ニコンインステック	NEXIV VMZ-R6555	27	800	加藤
23	ハイエンド3次元CAD/CAMシステム	PTC社	Pro/ENGINEER Wildfire 4	10	110	内田(富)
24	3D鋳型積層造形装置	シーメット社	IS-800SA	27	4,950	内田(富)
25	3次元X線CTシステム	(株)東芝	TOSCANER-32300μFD	28	2,850	内田(富)
26	鋳造CAEシステム	クオリカ	JSCAST	29	580	内田(富)
27	高精度3次元プロッターシステム	OBJET	CONNEX500	21	7,330	黒沢
28	3次元CADシステム	DASSAULT SYSTEMS	SOLID WORKS2015	28	500	黒沢
29	再資源化焼結炉	アドバンテック東洋(株)	KS-1703型	7	160	遠田
30	管状炉	タナカテック	MPH-6VGS	15	520	遠田
31	炭化賦活炉	(株)ウエーブ二十一	炭化賦活炉 T-2000L	16	1,210	遠田
32	ナノバブル評価装置	マイクロトラック・ベル株式会社	ZetaView-PMX100SP	29	410	遠田
33	空圧落下衝撃試験装置	ボクスイ・ブラウン(株)	SM-110-MP型	3	110	近藤(康)
34	絶縁耐圧試験器	日置電機(株)	3159	14	110	近藤(康)
35	高周波3次元電磁界シュミレータ	アンソフト	HFSSV・10・0	17	970	丹

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
36	三次元電磁界最適化設計ツール	アンソフト・ジャパン(株)	Optimetrics	18	110	丹
37	電磁界解析用ワークステーション	DELL	PrecisionT5400	20	110	丹
38	差動プローブセット	ソニー・テクトロニクス	P6330・P5210・TCP202S	14	110	佐々木(信)
39	光テストシステム装置	横河電機	AQ2200	17	710	佐々木(信)
40	ベクトルシグナルジェネレータ	アジレント	V2920A	21	310	佐々木(信)
41	ミックスドシグナルオシロスコープ	日本テクトロニクス	MSO4104	20	110	佐々木(信)
42	ソフトウェア品質評価試験システム	株式会社ハートランドデータ	DT10 STD Value IVセット	26	260	佐々木(信)
43	計測制御ソフトウェア開発システム	National Instruments(株)	LabVIEW 2010プロフェッショナル開発システム	23	110	佐々木(大)
44	プレジジョンパワーアナライザ	横河電機(株)	WT3000	23	180	佐々木(大)
45	ネットワーク・アナライザ・システム	アジレント・テクノロジー(株)	E8364A	14	1,260	黒澤
46	総合熱分析装置	セイコー電子工業(株)	EXSTAR6000	8	890	杉山
47	電気伝導率・熱電率測定装置	真空理工(株)	ZEM/PEM-1型	9	1,410	杉山
48	熱膨張測定装置	理学電機	Thermo Plus 2	15	470	杉山
49	熱特性測定装置	NETZSCH	LFA457-A21 MicroFlash	21	1,210	菅原
50	高温動弾性率測定装置	東芝タンガロイ(株)	UMS-HL	10	3,410	関根
51	電界放射走査電子顕微鏡	日立製作所	S-4500	8	620	木村
52	S-4500用オートステージ	日立製作所	S-8432型	12	110	木村
53	電子プローブマイクロアナライザ	日本電子(株)	JXA-8200ほか	13	1,680	菅原
54	圧縮成形機	東洋精機(株)	試験用加硫プレス 30ton f	S58	280	工藤(素)
55	プラスチック衝撃試験機	上島製作所	シャルピーJIS7111	S58	110	工藤(素)
56	恒温恒湿器	タバイエスペック(株)	LHU-112M	9	110	工藤(素)
57	3D射出成形シミュレーションシステム	富士通(株)	CELSIUS W480-NTM	23	1,150	工藤(素)
58	マイクロオームメータ	アジレント・テクノロジー(株)	34420A	18	110	工藤(素)
59	示差走査熱量計	セイコーインスツルメンツ株式会社	X-DSC7000	23	630	工藤(素)
60	プラスチック万能材料試験機(CFRP用)	インストロン(株)	5967型	24	940	工藤(素)
61	メルトインテグサ	(株)東洋精機製作所	型式G-01	25	250	工藤(素)
62	真空加熱プレス装置	井元製作所	1824型	19	110	菅原
63	電子天秤	ザルトリウス(株)	MC210S	10	110	工藤(素)
64	3次元CAD/CAMシステム	ダッソーシステムズ	CATIA V5他	19	1,620	加藤
65	色彩色差計	日本電色工業(株)	SQ-2000	12	290	工藤(素)
66	表面抵抗測定装置	アジレント・テクノロジー(株)	4339B	16	120	工藤(素)
67	フーリエ変換赤外分光光度計	日本分光(株)	IRT-7000	21	840	工藤(素)
68	粘弾性測定装置	Anton Paar社	MCR302	26	1,120	工藤(素)
69	低高抵抗率測定システム	(株)三菱アナリック	ロレスタMCP-T610,ハイレスタMCP-HT800	26	210	野辺
70	プラスチック自動比重計	東洋精機製作所	DSG-1	28	100	野辺
71	デジタル硬度計	テクロック	GSD-1	29	100	野辺
72	電動式塗工機	(株)小平製作所	YOA-B型	18	110	菅原
73	小型電気炉	(株)セイシン企業	PART-3	2	260	菅原

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
74	低温恒温水槽	小松エレクトロニクス	DW-621	8	110	菅原
75	セミビッカース硬度計	マツザワ	PVT-7S	21	430	関根
76	超硬製転動ミル用容器	(株)伊藤製作所		20	110	関根
77	マイクロビッカース硬度計	(株)マツザワ	AMT-X7FS-B	28	270	関根
78	X線応力測定装置	(株)マックサイエンス	MXP3AHP	7	1,730	木村
79	原子吸光分光分析装置	日本ジャーレルアッシュ	SOLAAR M-6	15	1,100	工藤(素)
80	炭素・硫黄分析装置	LECO社	CS-200型	13	890	工藤(素)
81	高周波プラズマ発光分光分析装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社	iCAP6300 Duo	23	3,670	工藤(素)
82	スクラッチ試験機	新東科学(株)	TYPE. 22H	6	400	瀧田
83	微小硬さ試験機	(株)フィッシャー・インストルメンツ	H-100	14	490	瀧田
84	X線回折装置	リガク	RINT-2500	9	720	菅原
85	低温灰化装置	ヤマト化学	PDC-210	15	680	工藤(素)
86	電気マuffle炉	アドバンテック東洋	FUS612PA	15	360	工藤(素)
87	ドラフトチャンバー	(株)ダルトン	DFB11-DFC14,DFD31	27	730	工藤(素)
88	精密旋盤	池具鉄工	D-20型	S47	260	加藤
89	ドリル研削盤	(株)藤田製作所	DG36A形	S55	220	加藤
90	NCフライス盤	遠州製作(株)	TNC 6MB付	S57	1,730	加藤
91	圧電型切削動力計	日本キスラー(株)	9257B	2	680	加藤
92	コンターマシン	アマダ	V-400	S47	110	加藤
93	直立ボール盤	(株)吉田製作所	YUD600	S47	110	加藤
94	卓上ボール盤	吉田鉄工所	YBD-420B	S46	110	加藤
95	超精密成形形状研削盤	ナガセインテグレックス	SGC-630S4AK-Pcnc	22	3,670	加藤
96	ミスト冷風供給装置	(株)荏原製作所	アイミストZELSR0401	12	140	加藤
97	油圧式強力高速弓鋸盤	津根マシンツール	PSB-350U	12	280	加藤
98	ワイヤーカット放電加工機	(株)ソディック	AQ360L	18	1,010	加藤
99	5軸制御立形マシニングセンタ	オークマ(株)	MU-400V II 型	26	2,740	加藤
100	プラスチック粉砕機	ホーライ	VC3-360	12	240	工藤(素)
101	鋳型焼成雰囲気炉	日新化熱工業(株)	EBS-9(改)	10	1,310	内田(富)
102	チタン用精密鑄造機	吉田キャスト	YSE-100	28	1,270	内田(富)
103	複合サイクル腐食試験機	スガ試験機	CYP-90	20	290	菅原
104	多目的高温炉	富士電波工業	ハイマルチ5000	8	1,040	杉山
105	マイクロフォーカスX線装置	日本フィリップス(株)	HOMX-161	5	1,830	木村
106	交直両用TIG溶接機	(株)ダイヘン	AVP-3000P	13	740	木村
107	真空チャンバー	日本精機	φ500×H250mm(内寸)材質:SUS304	14	280	木村
108	溶接部可視化装置	石川島播磨重工業(株)	ILV型	12	110	木村
109	レーザ加工装置	レーザライン	LDM3000-60	29	1,900	木村
110	プレス付真空熱処理装置	東京真空(株)	PRESS-VAC-2	3	580	瀧田
111	冷間等方加圧成形装置	アブライドパワー・ジャパン(株)	CIP-50-2000	7	310	関根

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
112	放電プラズマ焼結装置	住友石炭鉱業(株)	SPS-2080	8	5,400	関根
113	高速精密切断装置	平和テクニカ(株)	HS-100G II	29	300	関根
114	極間式磁気探傷機	日本工機	BY-1	S43	110	木村
115	超音波映像装置	日立エンジニアリング・アンド・サービス	FS200 II	22	1,780	木村
116	磁気探傷機	(株)島津製作所	PRA-80型	S46	230	木村
117	超音波探傷器	東京計器	SM80型	S53	510	木村
118	X線透過検査装置	理学電気工業(株)	300EG-B2L型	S55	1,000	木村
119	JSNDI仕様デジタル超音波探傷器	GEインスペクション・テクノロジーズ・ジャパン(株)	USM35X JE	23	160	木村
120	3Dプリンターシステム	STRATASAS	FORTUS250mc	25	1,120	沓澤
121	ロックウェル硬さ試験機	(株)アカシ	ATK-F1000	7	190	内田(富)
122	ビッカース硬度計	(株)アカシ	AVK-C2500	4	110	内田(富)
123	XY自動テーブル付硬度計	明石製作所	MS-4	S60	250	内田(富)
124	試料研磨機	ビューラー	エコット4000	20	720	黒沢
125	電解研磨装置	ストルアス社	ポレクトロール	9	230	木村
126	セラミックス研磨装置	丸本ストラウス(株)	アブラミン	10	2,670	関根
127	セラミックス自動精密切断機	丸本ストラウス(株)	アキュトム50	11	400	関根
128	万能材料試験機	Instron	5985	22	2,460	木村
129	小型造粒機	日本アイリッヒ(株)	アイリッヒ逆流式高速混合機RVO2型	2	200	菅原
130	ボールミル	日陶科学	架台二連式AN-3S無段変速28~100bpm	1	110	菅原
131	中型電気炉	(株)モトヤマ	SH-3045E	10	900	菅原
132	遊星回転ボールミル	(有)伊藤製作所	LA-PO412	8	210	関根
133	アトライタ	日本コークス工業(株)	MAISE-X	25	350	関根
134	真空乾燥用ミキサ	日本コークス工業(株)	FMミキサ、FM10C/I-X型	26	910	関根
135	真空溶解炉	富士電波工業(株)	FVPM-10型	7	1,890	内田(富)
136	ニューマブラスター	(株)不二製作所	FDQ-4S	S57	300	内田(富)
137	動的ひずみ解析装置	(株)共和電業	EDX-1500A-16AC	10	110	内田(富)
138	発光分析装置	(株)SPECTRO Analytical	SPECTROLAB M	14	1,310	黒沢
139	シャルピ衝撃試験機	(株)島津製作所	30kgm型	S54	140	内田(富)
140	小野式回転曲げ疲労試験機	(株)島津製作所	H6型	S62	110	内田(富)
141	万能試験機	島津製作所	UH-F300kNI	19	700	瀧田
142	スガ摩耗試験機	スガ試験機(株)	NUS-ISO-3型	1	170	関根
143	摩耗試験機	(株)エー・アンド・ディ	EFM-3-EM	9	420	関根
144	射出圧縮成形装置	ファナック(株)	ROBOSHTO α-100C	9	1,730	工藤(素)
145	標準試験片作製金型	AXXICON社	AIM Mould System	13	230	工藤(素)
146	押出機	(株)テクノベル	KZW25TW-60MG-NH(1200)スクリュー径25φ	16	1,620	工藤(素)
147	集塵機	アマノ(株)	PIE45	18	490	工藤(素)
148	樹脂乾燥機	アドバンテック東洋	DRL823WA	16	220	工藤(素)
149	砥粒分散用超音波発生器	トミー精工	UD-201(S)	13	110	久住

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
150	平坦度測定装置	(株)ニデック	FT-900(ウエハ用)	25	1,270	久住
151	磁束密度測定装置	F.W.BELL	9550	9	130	丹
152	電界制御装置	トレック・ジャパン(株)	MODEL20/20B	10	110	久住
153	小型切削動力計	日本キスラー株式会社	9256C2	16	500	久住
154	自動研磨ヘッド	ビューラー	オートメット2000 60-1970	20	110	久住
155	除振台	明立精機	AYA-1809K4	21	110	久住
156	レーザー変位計	キーエンス	LC-2400	14	110	久住
157	電界砥粒制御用小型片面研磨装置	ビューラー	エコメット250/オートメット250	28	160	久住
158	電界砥粒制御用多機能ワイヤソー	(株)タカトリ	WSD-K2	30	1,010	久住
159	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	日本電子(株)	JSM-7900F	30	5,490	木村
160	電源装置	トレックジャパン(株)	MODEL609D-6	7	190	久住
161	15MHzファンクションウェーブジェネレータ	日本ヒューレットパッカード	33120A	11	110	久住
162	オシロスコープ	日本ヒューレットパッカード	HP-54645A	11	110	久住
163	安全キャビネット	エアータック	BHC-1006 II A/B3	20	110	久住
164	核酸増幅システム	三洋電機バイオメディカ(株)	MDF-192	17	310	久住
165	蛍光顕微鏡	ニコン	E400-RFL 1	15	200	久住
166	材料物性測定装置	東陽テクニカ	1260-MAS(ソーラートロン)	18	700	久住
167	3軸微細加工機	シグマテック	FS-1100PXY	15	840	久住
168	CCDカラーカメラ	東京電子	CS5270i-S	12	110	久住
169	ゼータ電位測定装置	Sysmex	Nano Z	19	340	久住
170	誘電率測定用サンプルホルダー	東陽テクニカ	SH2-Z	25	100	久住
171	動的光散乱式測定装置	(株)Malvern	ゼータナノサイザー ナノZSP	26	810	久住
172	サーマルサイクラー	Bio-Rad	T100	27	100	中村
173	プレートリーダー	Bio-Rad	iMark PCシステム	27	100	中村
174	蛍光式光ファイバー温度計	安立計器	FL-2000	28	100	中村
175	フローサイトメーター	ベックマン・コールター社	CytoFLEX 3レーザー13カラー	28	1,220	中村
176	研磨装置	不二越機械工業	SLM-140	22	490	久住
177	片面研磨装置	不二越機械工業(株)	SLM-140改	25	560	中村
178	高速引張試験機	島津製作所	HITS-T10	21	2,410	木村
179	落錘衝撃試験機	INSTRON	9205HV	21	1,470	木村
180	材料試験高速解析システム	(株)フォトロン	FASTCAM SA-X	24	800	木村
181	減圧除湿乾燥機	カワタ(株)	DV-30	26	250	野辺
182	高転写成形用急加熱冷却金型システム	山下電気(株)	超臨界発泡射出成形機用金型	26	1,110	野辺
183	熱電発電モジュール温度特性評価試験装置	サカタ理化学(株)	MS-010	24	520	菅原
184	立形マシニングセンタ用集塵防塵装置	アマノ	PiE-30SD	22	780	加藤
185	立形マシニングセンタ	ファナック	α-T14iD	16	470	加藤
186	超臨界発泡射出成形機	日精樹脂工業株式会社	NEX180III 25E	24	3,040	野辺
187	複合材料圧縮成形装置	(有)郷製作所	MBO05-GMS	27	1,410	工藤(素)

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
188	複合材硬化成形用オートクレーブ	株式会社 羽生田鉄工所	φ850 x 1500L	21	1,470	藤嶋
189	複合材料切断機	(株)丸東製作所	AC-300CF	22	580	藤嶋
190	フラットベット切断機	(株)ミマキエンジニアリング	CF2-1215RC-S	25	760	藤嶋
191	ワイヤーボンダー	TPT	モデル16	16	270	丹
192	バイポーラ電源	松定プレジジョン	POEF60-20	27	100	丹
193	プリント基板加工システム	日本LPKF株式会社	Protomat C100HF	16	460	佐々木(大)
194	直流安定化電源	菊水電子工業(株)	PAT80-100T WITH USB	27	180	佐々木(大)
195	電子負荷装置	菊水電子(株)	PLZ1004WH	27	100	佐々木(大)
196	パワーマルチメーター	横河電気	WT1030	8	110	佐々木(大)
197	雷サージ試験システム	(株)ノイズ研究所	LSS-15AX-C1/S	13	110	近藤(康)
198	静電気試験システム	ノイズ研究所	ESS-2000	14	110	近藤(康)
199	耐候性試験機	岩崎電気(株)	SUV-W161	25	1,540	近藤(康)
200	グローワイヤー試験機	Physics tecnicos Labor	TA03.35(付属チャンバBT-07)	25	320	近藤(康)
201	雑音総合評価試験機	(株)ノイズ研究所	MODEL EMC-5000S	1	890	佐々木(信)
202	ファストランジェント/バースト試験機	(株)ノイズ研究所	FNS-AX3-B50B	26	150	佐々木(信)
203	低温恒温高湿器	エスベック	PSL-2K	19	240	佐々木(大)
204	冷熱衝撃装置	エスベック(株)	TSA-71S-W	17	600	佐々木(大)
205	静電気試験器	ノイズ研究所	ESS-S3011A	29	200	伊藤(96)
206	衝撃波記録解析装置	Lansmont社	Test Partner TP3-USB	26	100	近藤(康)
207	複合環境試験装置	IMV株式会社	EM2502(1250/SA5M)(振動試験機本体) Syn-3HA-40(恒温恒湿槽)	26	1,720	佐々木(信)
208	真空乾燥器	EYELA	VOS-450SD	9	130	遠田
209	自動研磨装置	ビューラー社	AUTOMET2&ECOMET3	9	170	遠田
210	スクラバー付ドラフトチャンバー	オリエンタル技研工業(株)	GNE-1500N	9	180	遠田
211	発熱量測定装置	(株)島津製作所	CA-4PJ	10	110	遠田
212	粉塵ドラフト	オリエンタル技研(株)	GNS-1800S	10	110	遠田
213	排ガス分析装置	(株)島津製作所	GC-17A	10	120	遠田
214	CHN元素分析装置	(株)パーキンエルマー・ジャパン	24002CHNS/0	10	210	遠田
215	波長分散型蛍光X線装置	島津製作所	XRF-1700(4KW)	11	910	遠田
216	ガスロマトグラフ質量分析装置	横河アナリティカルシステムズ	Agilent 5973W	12	180	遠田
217	ガスクロ用オートインジェクター	島津製作所	AOC-20i	16	110	遠田
218	GC用熱分解装置	(株)島津製作所	PY-2020iD	21	520	遠田
219	サイクロンサンプルミル	静岡精機(株)	CSM-F1	20	110	遠田
220	ハロゲン化合物測定自動前処理装置	三菱化学(株)	AQF-100	18	730	遠田
221	ビード作製装置	東京科学(株)	TK-4100型	16	810	遠田
222	ハンディ型燃焼排ガス分析計	(株)テストー	t350システムXL	23	130	遠田
223	粒度分布測定装置	日機装(株)	MT3300EX2-SDC-H	25	580	遠田
224	赤外線サーモグラフィカメラ	日本アビオニクス(株)	R300SR-H	26	100	遠田
225	ハロゲン化合物測定用検出器	Thermo SCIENTIFIC 社	ICS-1600	26	410	遠田

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
226	ガス蒸気吸着量測定装置	日本ベル(株)	BELSORP-max	26	920	遠田
227	超純水製造装置	アドバンテック東洋	RFU665DA	26	100	遠田
228	低温恒温恒湿器	タバイエスペック(株)	PL-3SP型	5	180	遠田
229	分光光度計	(株)日立製作所	U-3000	10	350	遠田
230	ICP質量分析装置	アジレント・テクノロジー(株)	Agilent 7500 Series ICP-MS	18	1,680	遠田
231	イオンクロマトグラフ(陰イオン・陽イオン・糖分析システム)	ダイオネクス	ICS-3000+2100型	22	1,570	遠田
232	吸着性能評価装置	Quantachrome社	ChemBET-3000型	16	700	遠田
233	バイオシェーカー	タイテック(株)	BR-43FL-MR	23	110	遠田
234	分子量分布測定装置	(株)島津製作所	ProminenceGPCシステム	25	390	遠田
235	高感度ガスクロマトグラフ	(株)島津製作所	Tracera	27	470	遠田
236	微粉碎機	中央化工機(株)	MB-1	9	110	遠田
237	粗粉碎機	三田村理研工業(株)	SR-2	9	140	遠田
238	凍結粉碎器	日本分析工業	JFC-1500型	15	300	遠田
239	小型タンデムリング粉碎機	中央化工機商事(株)	TR-LM	24	110	遠田
240	アスファルト用乾燥機			S46	110	遠田
241	ガスコンロ			S55	110	遠田
242	ローラーコンパクター	谷藤	TR-323C	S47	140	遠田
243	蛍光X線膜厚計	セイコー電子工業	SEA-5120	6	1,410	岡田
244	電子スピン共鳴測定装置	ブルカー・バイオスピン社	EMXplus型(マイクロ波ブリッジ含)	25	1,830	鈴木
245	薄膜・粉末両用型高輝度X線回折装置	リガク	SmartLab9K-INP	29	2,580	鈴木
246	イオンスパッタ装置	日本電子	JUC-5000	4	2,040	岡田
247	マイクロオージェ電子分光装置	日本電子(株)	JAMP-7830F	14	9,270	岡田
248	実体顕微鏡	オリンパス	SZH-141	4	350	岡田
249	光電子分光装置(ESCA)	アルバックファイ	5600MC	4	17,910	千葉
250	卓上顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	Miniscope TM3030Plus,EDX:Quantax70	27	770	千葉
251	紫外分光式磁気特性評価装置	ネオアーク	BH-M800UV-HD-10	17	1,410	山根
252	ポータブル型分光測定装置	ARCopix S.A.社	ARCspectro FT-NIR Rocket 0.9-2.6	26	210	山根
253	モノクロメータ式分光光源	朝日分光(株)	MAX-303+,CMS-100	27	200	山根
254	2次元光検出器	ビットラン	BQ-73LN	22	120	近藤(祐)
255	高感度マグネットメータ	プリンストンメジャメント社	MicroMag2900	5	4,510	鈴木
256	ダイヤラップ研磨システム	マルトー	ML-150P	5	110	岡田
257	低速切断機	サウスベイテクノロジー	SBT650	5	110	岡田
258	卓上プラズマエッチング装置	三友製作所	TP-50B	27	470	伊勢
259	純水・超純水製造装置	アドバンテック	RFU655DA・RFP543RA	22	240	近藤(祐)
260	恒温恒湿槽	ADVANTEC	AGX-224	7	310	荒川
261	静電容量微小変位計	ナノテックス	PS-Ⅲ-5D	16	110	荒川
262	金属顕微鏡	ニコン	XPF-UNRB	4	960	伊勢
263	ハイトゲージ	ハイデンハイ	CERTO-CT60M	6	430	伊勢

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
264	静電式バターンニング装置	エンジニアリングシステム(株)	QDX500-V-XC	25	1,130	伊勢
265	ダイシング・ソー	ディスコ	DAD320	7	1,470	内田(勝)
266	イオンビームガン	アリオス	EMIS-212	17	440	内田(勝)
267	スパッタリング用パルス電源	日本MKS	RPG-50A-00	17	290	内田(勝)
268	スパッタ・蒸着複合装置	トッキ	SPS506	7	3,980	鈴木
269	分子線エビタキシー装置	エイコー・エンジニアリング	EW-100S	17	4,870	鈴木
270	MBEプロセスモニタ用四重極質量分析システム	英国ハイデン社		18	920	鈴木
271	スパッタ機用RFマッチングボックス	トッキ	RF-MN750	19	220	鈴木
272	MBE装置用成膜及び表面処理機能拡張設備	株式会社エイコー	1EK00-36109-6501	23	3,770	鈴木
273	補助ポンプ	サエスグループ(SAES Getters)	CapaciTorr D400-2	26	100	鈴木
274	ディスクスパッタ装置	日本真空技術	SSH-4S	5	12,570	山根
275	イオンミリング装置	コモンウェルス	ミラトロンIV	4	1,940	鈴木
276	クライオコンプレッサー	ブルックス・オートメーション社	8200空冷式	26	100	鈴木
277	工場顕微鏡システム	ニコン	MM-11U	4	2,990	伊勢
278	MEMS対応型マスクアライナ	ズース・マイクロテック	MA6BSA	15	1,990	伊勢
279	超音波洗浄装置	本多電子	W118	7	450	内田(勝)
280	純水・超純水製造装置	日本ミリポア株式会社	Milli-Q Integral 10	21	230	鈴木
281	サンプリングオシロスコープ	レクロイジャパン	9354TM	7	160	黒澤
282	高速スペクトラムアナライザ	HP	E4401B	11	280	黒澤
283	高速パルスジェネレータ	HP	HP81110A	11	240	黒澤
284	ルビジウム周波数標準発振器	スタンフォードリサーチ	FS725	17	110	黒澤
285	電波暗室・EMI測定システム	Rohde&Schwars	ESIB26a	16	9,740	黒澤
286	電波暗室用センサスキャナ	デバイス	DM3423AV1/0	19	210	黒澤
287	発振器	エヌエフ回路設計ブロック	WF1973	19	110	黒澤
288	ロックインアンプ	エヌエフ回路設計ブロック	LI5640	19	110	黒澤
289	低ノイズアンプ	TSJ	MLA-00118-B01-35	20	110	黒澤
290	高利得マイクロ波アンテナ	Electro Metrics	EM-6969	21	110	黒澤
291	自動車用直流電源インピーダンス安定化回路網	Schwarzbeck Mess Elektronik	NNBM8125	21	110	黒澤
292	CISPR22対応電波吸収体	TDK	IS-030A	22	110	黒澤
293	電磁シールド特性評価システム	テクノサイエンスジャパン	KEC法測定システム	22	120	黒澤
294	雑音電力測定システム	(株)東陽テクニカ	MAC600A-AJ, EPS/RFP-AJ	25	100	黒澤
295	雑音測定用疑似通信回路網	協立電子工業(株)	KNW-2208, KNW-441, およびF-51	25	100	黒澤
296	高周波発振器	アンリツ	MG3692C	26	150	黒澤
297	放射・伝導イミュニティ試験システム	東陽テクニカ	IEC61000-4-3, IEC61000-4-6 2008対応	27	1,400	黒澤
298	車載機器放射イミュニティ用アンテナ	東陽テクニカ	イミュニティ試験システム	29	200	黒澤
299	オシロスコープ	キーサイト・テクノロジー(株)	DSOX6004A	30	140	黒澤
300	電子負荷	(株)計測技術研究所	LN-300A-G7	26	100	木谷
301	電子負荷	(株)計測技術研究所	LN-300A-G7	26	100	木谷

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
302	EMC試験用交流安定化電源	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000S+ES2000B×2台	27	250	木谷
303	EMIレシーバー	(株)テクノサイエンスジャパン	ESW-26、TEPTO-DV/RE、TEPTO-DV/CE、TEPTO-DV/PE	30	880	木谷
304	走査型プローブ顕微鏡(走査型トンネル顕微鏡)	デジタル・インスツルメンツ	ナノスコープⅢ	4	8,010	経徳
305	超微小硬度計	日本電気	MHA-400	4	14,980	経徳
306	大型サンプルSPM観測ステージ	デジタル・インスツルメンツ	D3000	7	2,250	経徳
307	走査型プローブ顕微鏡用駆動システム	Veeco	RDS-F/DSP	13	110	経徳
308	MTF評価装置	トライオプティクス	Image Master HR LP	21	550	梁瀬
309	金属顕微鏡システム	オリンパス	BH3-MJL	6	1,520	梁瀬
310	分光エリプソメータ	日本セミラボ株式会社	SE2000	28	1,130	近藤(祐)
311	分光エリプソメータ用反射率測定モジュール	日本セミラボ(株)	SE-2000用	30	440	近藤(祐)
312	触針式表面形状測定装置	アルバック	DEKTAK150	21	250	千葉
313	ナノ加工用イオンビーム装置	セイコーインスツルメンツ(株)	SMI2050	14	4,090	近藤(祐)
314	クリーンブースB(H17導入)	日本エアーテック	ECB02-22D5	17	130	近藤(祐)
315	FFTアナライザ	HP	HP35670A	5	1,150	荒川
316	デジタルオシロスコープ	HP	HP54542A	5	780	荒川
317	光マイクロメータ	MTI	MTI-2000 1157	5	620	荒川
318	微小変位計光マイクロメータ	MTI	MTI-2000 1165	5	340	荒川
319	レーザードップラー振動計	小野測器	LV-1500	5	1,150	荒川
320	FFTサーボアナライザ	HP	HP35670A	7	640	荒川
321	高分解能光ファイバー式変位計	フォトリクス	ATW-01 +ATP-A20	12	220	荒川
322	高周波連続可変フィルタ(H13導入)	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	13	110	荒川
323	FFTアナライザー	アジレントテクノロジー	35670A	17	170	荒川
324	5ch 静電容量変位計	ナノテックス	PS-Ⅲ-5D	17	110	荒川
325	オートコリメータ	ニコン	6B	18	220	荒川
326	超高分解能光学スケール	Sony Manufacturing Systems Corporation	BH20	18	110	荒川
327	平面検出型光学スケール	Sony Manufacturing Systems Corporation	BZ	18	110	荒川
328	FFTアナライザー	小野測器	DS-2100	19	220	荒川
329	微小トルク検出器	ユニパルス	UTM II -0.05Nm	26	100	荒川
330	スペクトラムアナライザ	HP	HP4396B	9	930	荒川
331	高分解能オシロスコープ	HP	HP54540C	7	400	荒川
332	マイクロスコープ	ハイロックス	KH-7700	19	230	荒川
333	高分解能・光学スケール	ソニーマニファクチュアリングシステムズ(株)	BH20	20	110	荒川
334	ロジックアナライザ	アジレントテクノロジー(株)	16804A	20	240	荒川
335	オシロスコープ	アジレントテクノロジー(株)	DSO7104A	21	110	荒川
336	高分解能・光学スケール	ソニーマニファクチュアリングシステムズ	BH25, BD96-B1400HC特	21	120	荒川
337	ファンクションジェネレータ(2ch出力)	テクトロニクス株式会社	AFG3252	21	110	荒川
338	レーザー干渉変位計システム	株式会社小野測器	LV-2100	21	130	荒川
339	除振台	明立精機	MAPS-008A-G1010	22	270	荒川

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
340	走査型プローブ顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社	L-trace II	24	680	荒川
341	レーザドップラ振動計	小野測器	LV-1800	25	140	荒川
342	振動周波数分析器	株式会社エヌエフ回路設計ブロック	FRA5097	25	130	荒川
343	ピコメートル分解能非接触変位計	(株)マグネスケール	BN100	26	100	荒川
344	高分解能反射型レーザースケール	(株)マグネスケール	BF1,BD-96	26	100	荒川
345	差動型非接触振動計	小野測器(株)	LV-1800	26	150	荒川
346	デジタルオシロスコープ	キーサイトテクノロジー		29	230	荒川
347	小型赤外線サーモグラフィ	(株)アピステ	FSV-210L	30	170	伊藤(97)
348	GMR評価高磁界用マグネット電源	菊水電子工業	PBX20-20	10	110	山根
349	発振器	HP	HP81110A	11	240	木谷
350	クリーンブースC(H17導入)	日本エアテック	ACB-352C-特型	7	130	木谷
351	光学顕微鏡	ニコン	MM-11U	7	590	木谷
352	ローパスフィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	9	440	木谷
353	ロングメモリオシロスコープ	レクロイ	LC574AL	11	680	木谷
354	オシロスコープ	AgilentTechnologies	54622A	12	110	木谷
355	スペクトラムアナライザ	AgilentTechnologies	E4411B	12	110	木谷
356	高精度スピンスタンド	協同電子システム	LS1000/500PS-II K	16	2,510	木谷
357	GPIB直流電源装置	菊水電子	PB×40-5	5	260	千葉
358	磁気抵抗測定装置	ハヤマ	MRMS-10K	20	3,770	鈴木
359	スイッチ・マトリクス	ケースレーインズツルメンツ株式会社	4200-UL-LS-12	21	110	鈴木
360	静電力発生用高圧電源システム	松定プレジジョン	HAR-30P73.3	27	100	荒川
361	ハイスピードマイクロスコープ	キーエンス	VW-9000	28	400	荒川
362	粘度計	ブルックフィールド社	TVE-35E	29	100	荒川
363	表面張力計	協和界面科学	DY-500	29	170	荒川
364	小型旋盤	エムコ社	コンパクト8	5	590	伊藤(97)
365	立型帯鋸盤	ラクソー	VWS-55	5	280	伊藤(97)
366	偏光顕微鏡	オリンパス光学工業(株)	BHS-751-P型	S62	110	梁瀬
367	高性能LD光源	メレズグリオ	56RCS002/HV	21	110	梁瀬
368	色彩輝度計	コニカミノルタ	分光フィッティング方式 CS-200	25	130	梁瀬
369	高速カメラ	(株)ディテクト	HAS-D3M	25	110	近藤(祐)
370	液晶配向シミュレータ	シンテック(株)	LCD MASTER 3D	18	190	梁瀬
371	ラビング装置	E.H.C(株)	MR-100	18	270	梁瀬
372	UV加圧硬化装置	E. H. C	MLP-320G	19	110	梁瀬
373	シール剤塗布装置	岩下エンジニアリング	Ez-ROBO5/ACCURA DG	20	110	梁瀬
374	アッペ屈折計	アタゴ	DR-M4/1550	21	110	梁瀬
375	ヘッド観察用顕微鏡セット(ボアスコープ)	オリンパス	G080-034-090-55	5	110	梁瀬
376	光スペクトラムアラナイザ	横河電機	AQ-6315B	16	340	梁瀬
377	照明光学系設計システム	Zemax社	OpticStudio Professional版	27	220	梁瀬

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (平成)	使用料 (円/時間)	担当者
378	LCRメータ	HP	HP4284A	7	610	荒川
379	ズーム顕微鏡	ユニオン光学(株)	DZ2-SH	9	230	近藤(祐)
380	標準電圧電流発生器	アドバンテスト	R6161	5	230	内田(勝)
381	マルチメータ	HP	HP3458A	5	340	内田(勝)
382	B-Hループメータ(解析装置付き)	テスラ	MODEL4800(解析装置: マイテック: 高感度 M-VSM500R)	4	1,360	新宅
383	軟磁性用振動試料型磁力計	マイテック	高感度 M-VSM500R	7	370	新宅
384	アンプ付き電流プローブ	ソニーエレクトロニクス	AM503S+op05	11	110	木谷
385	デジタルオシロスコープ	LeCroy	WR6051A	16	110	木谷
386	有限要素解析用計算システム	エムエスシーソフトウェア(株)	Marc2014AIT	26	1,620	伊藤(97)
387	インピーダンスアナライザ	HP	HP4291A	6	1,680	黒澤
388	誘電率測定フィクスチャ	Agilent	16453A	20	110	黒澤
389	大規模データ処理用並列分散計算クラスタリングシステム	IBM	eServer325	16	150	黒澤
390	高周波連続可変フィルタ(H11導入)	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	11	180	木谷
391	フトリソグラフ用クリーンオープン	榎本化成	CSO-402BF	12	160	内田(勝)
392	スピンコータ	ミカサ株式会社	MS-A150	21	140	内田(勝)